

中華民國經濟部智慧財產局

INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS REPUBLIC OF CHINA

茲證明所附文件,係本局存檔中原申請案的副本,正確無訛,

其申請資料如下

This is to certify that annexed is a true copy from the records of this office of the application as originally filed which is identified hereunder:

申 請 日: 西元 2002 年 08 月 22 日

Application Date

申 請 案 號: 091118977

Application No.

申 請 人: 財團法人工業技術研究院

Applicant(s)

局 長

Director General



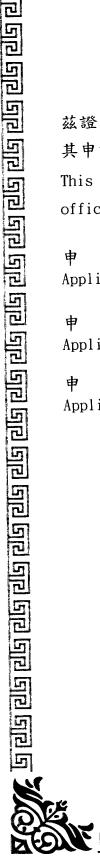
發文日期: 西元 2002 年 10 月 28 日

Issue Date

發文字號:

09111021039

Serial No.





that of the .	案號:	€ .	₹,
	The Total		APPL
類別:		1.4	
		4	

(以上各欄由本局填註)

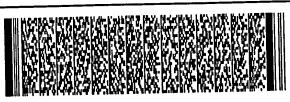
發明專利說明書		
	適用於校正雷射三次元量測器之方法及裝置 中 文	
發明名稱	Method And Apparatus For Calibrating Laser Three-Dimensional 英文 Digitizing Sensor	
	1. 羅文秀 姓 名 2. 林明慧 (中文)	
二、 發明人	1. Wen-Shiou LOU 姓名(英文)	
住	國籍 1.中華民國 2.中華民國	
	1. 新竹市振興路71號6樓 住、居所 2. 新竹縣竹東鎮忠孝街71巷35號	
	姓 名 (名稱) (中文)	
名英 國 住事 代姓中	姓名 (名稱) (英文)	
	國籍 1. 中華民國	
	住、居所 (事務所)	
	代表人 姓 名 (中文)	
	代表人 姓 名 (英文)	

四、中文發明摘要 (發明之名稱:適用於校正雷射三次元量測器之方法及裝置)

英文發明摘要 (發明之名稱:Method And Apparatus For Calibrating Laser Three-Dimensional Digitizing Sensor)

An method and apparatus provided for calibrating a laser three-dimensional digitizing sensor. The laser measurement sensor can project a laser light plane to the flat block and receive the reflected light to generate a two-dimensional digital image. By the laser light plane being horizontally parallel to the base plane, the flat block translating along the translating axis, and the flat block rotating a predetermined angle along the rotating axis which is vertically





四、中文發明摘要 (發明之名稱:適用於校正雷射三次元量測器之方法及裝置)

英文發明摘要 (發明之名稱:Method And Apparatus For Calibrating Laser Three-Dimensional Digitizing Sensor)

parallel to the base plane, the reference table of the two-dimensional digital image to the three-dimensional physical coordinate can be created.



本案已向

國(地區)申請專利

申請日期

案號

主張優先權

無

有關微生物已寄存於

寄存日期

寄存號碼

無

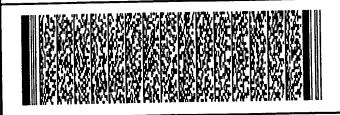
五、發明說明(1)

[本發明所屬之背景與動機]

習知之光學三角量測系統(Optical triangulation system)已廣泛應用於各種三度空間量測之應用中,例如於機器視覺、自動化檢測或者是使用於各式製造與組裝程序中;然而諸如此類之三次元量測系統,其性能優劣常取決於該系統之校正精度。因此,如何能針對三次元量測系統,設計出一套程序簡單且精確性高之校正程序與方法,確實為一重要之課題。

[習知技術之問題點]

如第1圖所示,該圖係表示一習知三次元量測系統之示意圖,包括一雷射發射元件1、一第一修正鏡組11、一光感測元件2、一第二修正鏡組21以及一待測物體3;其中,該雷射發射器1可發出一光線,並於通過該第一修正鏡組11後,投射在該待測物體3表面並形成一亮區;又,





五、發明說明 (2)

該三次元量測系統可藉由該光感測器2,接收經該待測物體3表面反射並透過該第二修正鏡組21補償後之光線。其中該光感測器2具有一類似相機之功能,可得到一組數位影像資料,故藉由該感測器接收光訊號並產生影像,可判別該物體表面於三度空間中之座標位置,此外更可利用如掃描之技術,進而建構一物體完整之三次元量測模型。

然而,如上述之三次元量測系統中,對於數位影像資料與三度空間座標之間作轉換時,須要考慮複雜之參數與計算,另由於一些附加光學元件之特性不同,亦常須導與如相機參數估計、鏡頭扭曲補償、座標轉換、雷射線參數估計等複雜程序,因此往往會增加校正時的複雜度與困難度,同時亦需要較高之校正技術與成本。

基於上述之考量,習知技術如美國專利No.4825308「Calibration of Three Dimensional Space」,主要係針對投射單點雷射的測頭設計其校正方法,該雷射量測頭亦使用習知之三角量測原理,在一個X、Y、Z三軸完全互相垂直的線性移動平台上放置一個六面完全垂直的方塊,讓方塊任意相鄰的三個平面與X、Y、Z軸平行(以下分別簡稱這三個平面為XY、YZ和XZ平面)。

其中,雷射測頭的位置不能讓雷射線與任一方塊平面垂直或平行,最好是在45度角的位置。因此,藉由當雷射投在XY平面的時候,移動XY平面,可校正該雷射點的Z方向座標;同理,雷射投在YZ平面可校正X方向座標,以及雷射投在XZ平面可校正Y方向座標。





五、發明說明(3)

然而,如上之校正方法及裝置乃是針對一般使用單點 掃描之雷射量測頭校正所設計,但是對於如本發明或者 有單線掃描特性之雷射量測頭而言並不適用。。且由於 有電射線是斜向投射至方塊上之平面,因此該平面的 係件(例如表面光滑程度)容易影響其校正精度,故 仍然必須作適當的補正,易增加校正之困難度;又 如此將不利於一些重、大型雷射量測頭之校正,如人體掃 描儀(Body Scanner)等。

此外,如前述之美國專利案No.4825308中,其校正裝置必須使用非常高精度的XYZ線性平台和方塊規,尤其X、Y、Z三軸的定位精度和垂直度必須非常高,因此設備體積較大,成本也相對較高。

[本發明之目的與功效]

本發明為專為單線掃描雷射測頭所設計,為一具有精確、快速等優點之三次元校正系統,能夠讓一般的使用者輕易操作,且本發明若使用於單點掃描雷射測頭之校正,亦可為一使用更簡便且成本低廉之應用。

本發明係採用較習知更簡單之校正機構,具有較少的軸數,故比較不佔空間而且容易組裝,也因此可提高該校正機構組裝之精度。

再者,雷射不必刻意與塊規表面傾斜一個角度,可以讓雷射測頭較自然地放在一基準平面上,讓校正系統本身





五、發明說明(4)

的隨機誤差降低。

本發明係於二維的影像與三度空間座標間,建立一對應之轉換關係,可減少電腦運算之時間,而且克服投光與取像鏡組的光學扭曲,確實提高量測精度。

[本發明之技術方法]

又本發明之校正雷射三次元量測器之方法,係藉由發射出之類與該基準平面平行,並利用一平面塊塊,並和一段該不可與基準平面垂直之旋轉動,以及該平面垂直之旋轉動,以是知角度。對於了一段,可以是一個人。對於一個人。

兹配合圖式說明本發明之較佳實施例。

請參閱第2圖,其中該圖係表示本發明之雷射三次元





五、發明說明 (5)

量測器校正裝置示意圖。如圖所示,本發明主要包括一部射量測頭4、一雷射平面5、一校正機構6、以及一基準平面7。

如圖所示,本實施例乃定義一三度空間之直角座標系X軸、Y軸以及Z軸。其中,該雷射量測頭4可發出一雷射平面5,且該雷射量測頭4與該校正機構6穩定地放置於該基準平面7上,又該基準平面7乃平行如圖中所示之XZ平面。

此外,該雷射量測頭4具有感測光線之功能,並可藉此產生一二維數位影像8(如第3B圖所示);一般而言,該雷射量測頭4可連接一電腦(未圖示),作為儲存數位影像資料與計算之用。

其中,該校正機構6係包括一平面塊規61、一旋轉部62以及一平移部63;又該平面塊規61包括一校正平面610。當實施校正程序時,該雷射平面5之光線將投射在該校正平面610上,並可產生一亮線51;以及,該雷射量測頭4可感測該亮線51,並產生一相對應之數位影像。藉由上述雷射量測頭4,並配合操作該校正機構6之動作,可完成如前所述之校正功能。

本發明之校正機構6主要係利用上述之平面塊規61作為校正之用,其中該平面塊規61設置於一旋轉部62之上,又該旋轉部62設置於一平移部63之上;此外,該平面塊規61可藉由該平移部62而沿著一平移軸631平移,以及藉由該旋轉部63繞著一旋轉軸621旋轉。如圖所示,該平移軸631之方向平行2軸,以及該旋轉軸621之方向平行Y軸,且





五、發明說明 (6)

垂直該基準平面7。

如此,藉由如上述之旋轉部62以及上述之平移部63,可使該平面塊規61沿著一平移軸631平移,以及繞著一旋轉軸621旋轉;又,上述之平移部62可為一線性滑軌,以及上述之旋轉部63,可為一結合馬達與減速機構帶動之旋轉台。

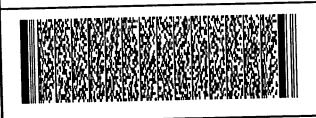
其中,本發明之校正程序如下:

步驟1:調整雷射平面5與標準座標系的XZ平面平行 首先調整該雷射量測頭4所發出之雷射平面5,使其與 標準座標系的XZ平面平行。如此,藉由該雷射平面5上任 意點於空間中之Y座標相同,致使如上所述投射於該校正 平面610上之亮線51具有相同之Y座標值。

步驟2:建立二維數位影像與三度空間Z座標的對應關係

完成上述步驟1後,先調整該平面塊規61使該校正平面610與圖中之Z軸呈垂直,接著於Z軸上定義複數個校正位置,使上述之平面塊規61沿著該平移軸631移動,且可藉由該雷射量測頭4於各校正位置處,分別擷取投射於該校正平面610上亮線51之數位影像資料。

請參閱第3A圖以及3B圖,其中如3A圖所示,該平面塊 規61可藉著該平移部63沿Z軸方向移動;如此,上述雷射 量測頭4所發出之雷射平面5,可分別在該校正平面610位 於一初始位置處產生一亮線611,位於一第一位置產生一 亮線612,以及位於一第二位置產生一亮線613。





五、發明說明 (7)

其中,該雷射量測頭4可分別針對上述三個預設之校正位置,藉由感測於該校正平面610上之亮線611、612、613,而於數位影像8上產生不同之圖案;其中對照第3A圖以及第3B圖所示,藉由感測於初始位置之亮線611,可於該數位影像8上產生對應之雷射影像81;藉由感測於第一位置之亮線612,可產生於該數位影像8上對應之雷射影像82;以及,藉由感測於第二位置之亮線613,可於該數位影像8上產生對應之雷射影像83。

如此,利用該平面塊規61沿Z軸方向平移,可以分別得到該校正平面610上之亮線51於不同Z座標位置之數位影像資料,且如第3B圖所示之雷射影像81、82、83,亦會隨Z座標之變化而出現在不同位置。如此,本發明可以在雷射量測頭4的量測範圍內,建立並記錄二維數位影像座標與空間中Z座標值一對一之對應關係。

步驟3:建立二維數位影像與三度空間X座標的對應關係

此步驟之第一個動作必須先將平面塊規61沿上述旋轉軸621轉動一已知的角度θ;於本實施例中,該旋轉軸621係位於該平面塊規61之中心位置。

由於在完成步驟2之後,由於已可得知數位影像對應於三度空間中之Z座標值,因此可藉由平面塊規61所處之校正位置座標值,以及步驟2所得之的結果,計算出雷射影像所對應之X座標值,其計算之方式如下:

請參閱第4圖, Zp係表示該平面塊規61中心位置之Z座





五、發明說明 (8)

標值,為一已知值;Zm係表示於校正平面610所產生亮線上任一點所量測得到之Z座標值;其中,Zm可根據所得之數位影像,並藉由上述步驟2建立之影像對Z座標之對應關係而推算得知;又,如上所述該平面塊規61乃旋轉一已知角度θ。至此,Zp、Zm以及θ皆為已知,故若令該平面塊規61中心位置為一座標原點,則可得到該校正平面610上於Zm處所對應之X軸座標dX:

 $dX = (Zp - Zm) \cot(\theta)$;

根據上述之公式,接下來可藉由將該平面塊規61沿上述旋轉軸621轉動一已知的角度θ,並於2軸上定義複數個校正位置,以使上述之平面塊規61沿著2軸移動,且依序於各校正位置處藉由該雷射量測頭4擷取個別之數位影像。

如此,我們可以在雷射量測頭4的量測範圍內,並藉由上述公式,建立各校正位置之雷射影像與實際三度空間 X座標值一對一之對應關係,並藉此記錄每個雷射影像位 置相對應的X座標。

由於在步驟1中,已將雷射平面5調整至與XZ平面平行,因此投射於該校正平面61上之亮線51於空間中之Y座標皆相同,而至此已可建立該數位影像8對應至空間中三維座標之對應關係。

然而,若未執行步驟1之校正程序,或該雷射平面5已固定或無法調整與上述XZ平面平行時,則可藉用如步驟3之相同手法,進行如下步驟4之校正程序,以建立雷射影





五、發明說明 (9)

像位置與三維Y座標的對應關係。

步驟4:建立雷射影像位置與三度空間Y座標的對應關係

假如雷射平面未與XZ平面平行,則可將該平面塊規繞 X軸傾斜一已知的角度ψ,藉此建立數位影像與實際三維Y 座標位置的對應關係。

請參閱第5圖,Zp係表示該平面塊規61中心位置之Z座標值,為一已知值;此外,於校正平面610之亮線上任一點之Z座標值Zm,可藉由量測影像與步驟2之結果推算得知;又,已知上所述該平面塊規61 乃繞X 軸旋轉一角度,故若令該平面塊規61 中心位置為X 軸之原點,則可得到該校正平面61 上於Zm處之Y 軸座標dY:

 $dY = (Zp - Zm) \cot(\phi);$

如此,我們可以在雷射量測頭4的量測範圍內,建立各校正位置之雷射影像與實際三度空間中Y軸座標一對一之對應關係,並藉此記錄每個雷射影像位置相對應的Y座標。

然而,於本實施例中僅具有一可沿Y軸向旋轉之旋轉軸,唯若需沿X軸以及Y軸旋轉時,亦可藉由一具已知角度 θ或已知角度ψ之角形塊規(未圖示),代替上述之旋轉軸 與平面塊規,以使該角形塊規可與雷射平面5可形成一預 設之夾角。

至此如上之校正程序已算大致完成,藉由依序建立一二維影像與三度空間中Z軸向、X軸向、Y軸向之對應關





五、發明說明 (10)

係,可完成各校正位置之校正動作;然而於相鄰之校正位置中間尚存在之空白影像區域,可利用內插法估算相對應的座標,唯當上述之校正位置愈密集,愈能提升量測時的精確度。

本發明為一專為單線掃描雷射測頭設計的一套精確、快速三次元校正系統,能夠讓一般的使用者輕易操作。藉由較簡單的校正機構以及較少的軸數(一個平移軸以及一個旋轉軸),可節省空間且具有容易組裝與容易控制機構組裝精度。再者,雷射不必刻意與塊規表面傾斜一個角度,可以讓雷射測頭較自然地放在校正平台上,讓校正系統本身的隨機誤差降低。

更進一步的,本發明藉由在二維數位影像與三度空間之物體表面座標之間,建立一個轉換之對應關係,可減少電腦的運算時間,並可克服投光與取像鏡組的光學扭曲,確實提高量測精度。

雖然本發明已於較佳實施例揭露如上,然其並非用以限定本發明,任何熟習此項技藝者,在不脫離本發明之精神和範圍內,仍可作些許的更動與潤飾,因此本發明之保護範圍當視後附之申請專利範圍所界定者為準。





圖式簡單說明

圖 ;

為使本發明之上述目的、特徵、和優點能更明顯易懂,以下特舉較佳之實施例並配合所附圖式做詳細說明。

圖式之簡單說明:

第1圖係習知雷射三次元量測器之示意圖;

第2圖係本發明之雷射三次元量測器校正裝置示意

第3A圖係平面塊規於Z軸上不同校正位置之示意圖; 第3B圖係對於各校正位置所產生之數位影像示意圖;

第4圖係利用平面塊規旋轉一已知角度 θ 用以校正X 軸向座標之示意圖;

第5圖係利用平面塊規旋轉一已知角度ψ用以校正Y軸向座標之示意圖。

標號說明:

- 1~ 雷射發射元件
- 11~第一修正鏡組
- 2~光感测元件
- 21~第二修正鏡組
- 3~待測物體
- 4~雷射量測頭
- 5~雷射平面
- 51~ 亮線
- 6~校正機構
- 61~平面塊規



圖式簡單說明

- 610~校正平面
- 611~初始位置之亮線
- 612~第一位置之亮線
- 613~第二位置之亮線
- 62~旋轉部
- 621~旋轉軸
- 63~ 平移部
- 631~平移軸
- 7~基準平面
- 8~數位影像
- 81~初始位置之雷射影像
- 82~第一位置之雷射影像
- 83~第二位置之雷射影像



六、申請專利範圍

1. 一種校正雷射三次元量測器之方法,至少包括下列步驟:

定義一由X軸、Y軸、Z軸所組成之三維空間垂直座標系;

提供一校正平面;

將該校正平面沿著Z軸方向平移,建立量測所得之二維數位影像對應於Z軸向座標值之對應關係;

將該校正平面沿Y軸旋轉一已知角度,並將上述校正平面沿著Z軸方向平移,利用先前所得之結果,建立量測所得之二維數位影像對應於該X軸方向座標值之對應關係。

2. 如申請專利範圍第1項所述之校正雷射三次元量測器之方法,其更包括下列步驟:

將該校正平面沿X軸旋轉一已知角度,並將上述校正平面沿著Z軸方向平移,利用先前所得之結果,建立量測所得之二維數位影像對應於該Y軸方向座標值之對應關係。

3. 一種校正雷射三次元量測器之方法,包括下列步驟:

提供一基準平面、一雷射量測頭用於發出一雷射平面、一平面塊規包括一校正平面、一旋轉軸垂直該基準平面、一平移軸垂直該旋轉軸;

投射該雷射平面於該校正平面上,並形成一亮線;調整該雷射平面使平行該基準平面;



六、申請專利範圍

調整該平面塊規,使該校正平面垂直該平移軸;

在欲量測之範圍內,沿該平移軸設定複數個校正位置,將該平面塊規依序沿該平移軸移動至上述之校正位置,並記錄其座標以及雷射量測頭所得到相對應之二維影像;

令該平面塊規沿該旋轉軸旋轉一特定角度,並在欲量測之範圍內沿該平移軸設定複數個校正位置,將該平面塊規依序沿該平移軸移動至上述之校正位置,並記錄上述校正位置之座標,以及相對應之雷射量測頭所得之二維影像。

- 4. 一種校正雷射三次元量測器之裝置,包括:
- 一基準平面;
- 一雷射量測頭,設置於該基準平面上,且可發出一雷射平面;
 - 一校正機構,設置於該基準平面上,包括:
- 一平面塊規,包括一校正平面,其中上述雷射平面可 在該校正平面上產生一亮線,該雷射量測頭可藉由感測該 亮線,而產生一對應之二維數位影像。
- 5. 如申請專利範圍第4項所述之校正雷射三次元量測器之裝置,其中該校正機構更包括一旋轉部,又該旋轉部包括一旋轉軸,其中該旋轉軸垂直該基準平面,且該平面塊規可藉由該旋轉部而沿該旋轉軸旋轉。
- 6. 如申請專利範圍第4項所述之校正雷射三次元量測器之裝置,其中該校正機構更包括一平移部,又該平移部



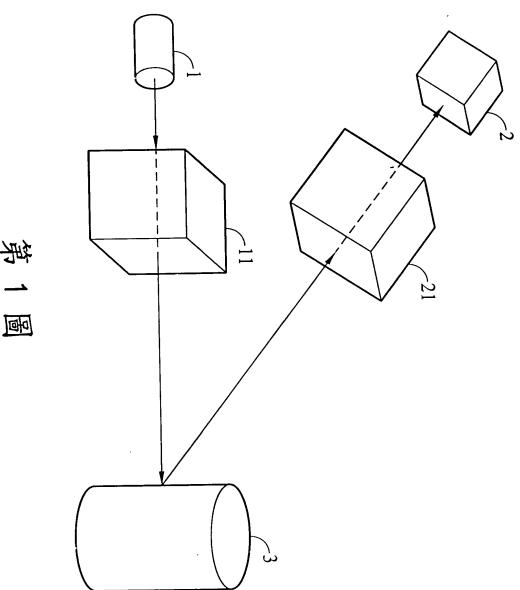
六、申請專利範圍

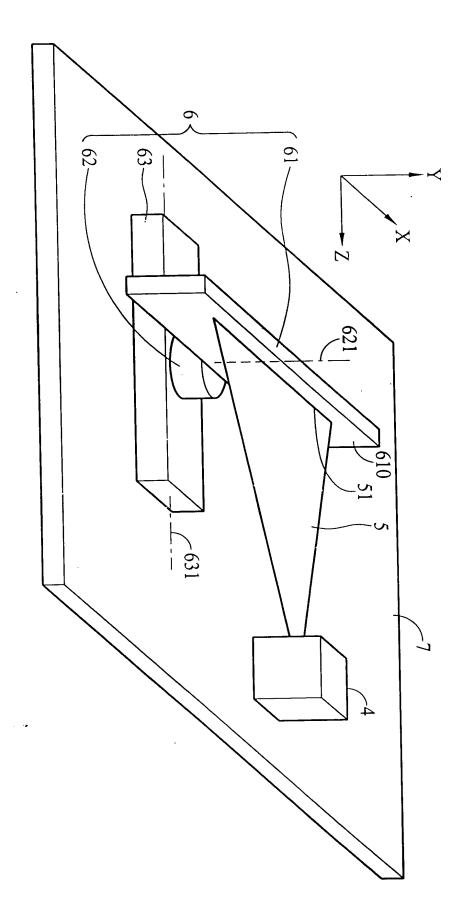
包括一平移軸,其中該平移軸垂直該旋轉軸,且該平面塊規可藉由該平移部沿該平移軸移動。

7. 如申請專利範圍第4項所述之校正雷射三次元量測器之裝置,其中該平移部為一線性滑軌。

8. 如申請專利範圍第4項所述之校正雷射三次元量測器之裝置,其中該旋轉部為一結合馬達與減速機構帶動之旋轉台。







第2圖

第3A圖

